PERRY JOHNSON LABORATORY ACCREDITATION, INC.

Certificate of Accreditation

Perry Johnson Laboratory Accreditation, Inc. has assessed the Laboratory of:

Fischer Instruments K.K. Quality Control Department

1-9-16 Shinmei Soka-shi, Saitama 340-0012

(Hereinafter called the Organization) and hereby declares that Organization is accredited in accordance with the recognized International Standard:

ISO/IEC17025:2017

This accreditation demonstrates technical competence for a defined scope and the operation of a laboratory quality management system (as outlined by the joint ISO-ILAC-IAF Communiqué dated April 2017):

Mechanical Calibration
(As detailed in the supplement)

Accreditation claims for such testing and/or calibration services shall only be made from addresses referenced within this certificate. This Accreditation is granted subject to the system rules governing the Accreditation referred to above, and the Organization hereby covenants with the Accreditation body's duty to observe and comply with the said rules.

For PJLA:

Tracy Szerszen
President

Initial Accreditation Date:	*Issue Date:*	*Expiration Date:*
October 19, 2023	October 19, 2023	January 31, 2026
Revision Date:	*Accreditation No.:*	*Certificate No.:*
November 29, 2024	117435	L23-754-R1

Perry Johnson Laboratory
Accreditation, Inc. (PJLA)
755 W. Big Beaver Rd., Suite 1325
Troy, Michigan 48084

The validity of this certificate is maintained through ongoing assessments based on a continuous accreditation cycle. The validity of this certificate should be confirmed through the PJLA website: www.pjlabs.com

Certificate of Accreditation: Supplement

Fischer Instruments K.K. Quality Control Department

1-9-16 Shinmei Soka-shi, Saitama 340-0012

Contact Name: Hiroki Hoshino   Phone: 048-929-3455

Accreditation is granted to the facility to perform the following calibration:

Mechanical

MEASURED INSTRUMENT, QUANTITY OR GAUGE	RANGE OR NOMINAL DEVICE SIZE AS APPROPRIATE	CALIBRATION AND MEASUREMENT CAPABILITY EXPRESSED AS AN UNCERTAINTY (±)	CALIBRATION EQUIPMENT AND REFERENCE STANDARDS USED
Magnetic induction coating thickness gauge [F]	9.4 µm to 836 µm		SOP for Calibration of Coating Thickness Gauge (SRVOP001) On the basis of: ISO 2178 Film: CH-STD-24075, CH-STD-24056-24876, CH-STD-24049-24687, CH-STD-2023-50316-23465 series Block gage
	9.4 µm	0.089 µm/µm + 0.84 µm	
	72.8 µm	0.019 µm/µm + 1.4 µm	
	836 µm	0.013 µm/µm + 11 µm	
	1 000 µm to 8 000 µm		
	1 000 µm	0.002 µm/µm + 2.1 µm	
	4 000 µm	0.0014 µm/µm + 5.5 µm	
	8 000 µm	0.0032 µm/µm + 25.0 µm	
Amplitude sensitive eddy current coating thickness gauge [F]	11 µm to 836 µm		SOP for Calibration of Coating Thickness Gauge (SRVOP001) On the basis of: ISO 2360 Film: CH-STD-24075, CH-STD-24056-24876, CH-STD-24049-24687, CH-STD-2023-50316-23465 series Block gage
	11 µm	0.12 µm/µm + 1.3 µm	
	72.8 µm	0.02 µm/µm + 1.4 µm	
	836 µm	0.013 µm/µm + 11 µm	
	1 000 µm to 3 000 µm		
	1 000 µm	0.0012 µm/µm + 1.2 µm	
	1 500 µm	0.0026 µm/µm + 3.9 µm	
	3 000 µm	0.0066 µm/µm + 6.6 µm	
Phase-sensitive eddy current coating thickness gauge [F]	121.5 µm or less		SOP for Calibration of Coating Thickness Gauge (SRVOP001) On the basis of: ISO 21968 Zn/Fe Standard ESD20
	5.03 µm	0.068 µm/µm + 0.34 µm	
	11.86 µm	0.049 µm/µm + 0.59 µm	
	45.1 µm	0.030 µm/µm + 1.4 µm	
	121.5 µm	0.014 µm/µm + 1.7 µm	
Electrical resistance coating thickness gauge [F]	9.87 µm or less		SOP for Calibration of Coating Thickness Gauge (SRVOP022) On the basis of: ISO 14571 Cupper ISO Standard
	4.74 µm	0.12 µm/µm + 0.57 µm	
	9.87 µm	0.12 µm/µm + 1.1 µm	

Certificate of Accreditation: Supplement

Fischer Instruments K.K. Quality Control Department

1-9-16 Shinmei Soka-shi, Saitama 340-0012

Contact Name: Hiroki Hoshino   Phone: 048-929-3455

Accreditation is granted to the facility to perform the following calibration:

Mechanical

MEASURED INSTRUMENT, QUANTITY OR GAUGE	RANGE OR NOMINAL DEVICE SIZE AS APPROPRIATE	CALIBRATION AND MEASUREMENT CAPABILITY EXPRESSED AS AN UNCERTAINTY (±)	CALIBRATION EQUIPMENT AND REFERENCE STANDARDS USED
X-ray fluorescence coating thickness gauge F	1.68 µm to 13.4µm		SOP for Calibration of Coating Thickness Gauge (SRVOP024) On the basis of: ISO 3497 Zn/Fe Standard
	1.68 µm	0.11 µm/µm + 0.18 µm	
	10.0 µm	0.11 µm/µm + 1.1 µm	
	13.4 µm	0.11 µm/µm + 1.4 µm	

1. The CMC (Calibration and Measurement Capability) stated for calibrations included on this scope of accreditation represents the smallest measurement uncertainty attainable by the laboratory when performing a more or less routine calibration of a nearly ideal device under nearly ideal conditions. It is typically expressed at a confidence level of 95 % using a coverage factor *k* (usually equal to 2). The actual measurement uncertainty associated with a specific calibration performed by the laboratory will typically be larger than the CMC for the same calibration since capability and performance of the device being calibrated and the conditions related to the calibration may reasonably be expected to deviate from ideal to some degree.

2. The laboratories range of calibration capability for all disciplines for which they are accredited is the interval from the smallest calibrated standard to the largest calibrated standard used in performing the calibration. The low end of this range must be an attainable value for which the laboratory has or has access to the standard referenced. Verification of an indicated value of zero in the absence of a standard is common practice in the procedure for many calibrations but by its definition it does not constitute calibration of zero capacity.

3. The presence of a superscript F means that the laboratory performs calibration of the indicated parameter at its fixed location. Example: Outside Micrometer F would mean that the laboratory performs this calibration at its fixed location.

ペリージョンソン ラボラトリー アクレディテーション インク

認　定　証

ペリージョンソン ラボラトリー アクレディテーション インクは、
下記の試験所を審査しました。

株式会社フィッシャー・インストルメンツ
品質管理部

〒340-0012　埼玉県草加市神明 1-9-16

ここに本組織が、以下の認知された国際規格に基づき、認定されたことを証します。

ISO/IEC 17025:2017

本認定により、以下の範囲及び試験所品質マネジメントシステムの運営における技術的能力を
実証するものとします。(2017 年 4 月発行 ISO-ILAC-IAF 共同コミュニケに準ずる)

機械的校正
(詳細は付属書に記述)

上記試験及び／又は校正サービスに対する認定資格は本認定証内で言及された住所のみを対象とする。本認定は、上記規格の認定を管理するシステム規定に従い授与され、組織はその規定を遵守し、認定機関の任務を尊重することをここに誓約する。

PJLA

初回認定日	発行日	認定証有効期限
2023 年 10 月 19 日	2023 年 10 月 19 日	2026 年 1 月 31 日
改訂日	認定番号	認定証番号
2024 年 11 月 29 日	117435	L23-754-R1

トレーシー　サーツェン
プレジデント
Perry Johnson Laboratory
Accreditation, Inc. (PJLA)
755 W. Big Beaver Rd., Suite 1325
Troy, Michigan 48084

この認定証の有効性は、持続された認定に基づく継続審査を通して維持されています。
PJLA ウェブサイト (www.pjlabs.com)でご確認いただけます。

尚、本認定証は日本語翻訳版であり、英文の認定証を正式のものとする。

認　定　証　付　属　書

株式会社フィッシャー･インストルメンツ
品質管理部
〒340-0012　埼玉県草加市神明 1-9-16
星野　廣記　Tel: 048-929-3455

本認定を、上記組織の実施する下記校正について授与する。

機械的校正

校正を受けた計量機器または計測器	範囲または必要に応じて基準装置サイズ	不確かさとして表現された校正測定能力(±)	使用された校正機器および基準、規格
電磁式膜厚測定器 [F]	9.4 ㎛ to 836 ㎛		ISO2178 に基づく 作業手順書 膜厚計校正 (SRVOP001) フィルム：CH-STD-24075、CH-STD-24056-24876、CH-STD-24049-24687、CH-STD-2023-50316-23465 シリーズ ブロックゲージ
	9.4 ㎛	0.089 ㎛/㎛ ＋ 0.84 ㎛	
	72.8 ㎛	0.019 ㎛/㎛ ＋ 1.4 ㎛	
	836 ㎛	0.013 ㎛/㎛ ＋ 11 ㎛	
	1000 ㎛ to 8000 ㎛		
	1000 ㎛	0.002 ㎛/㎛ ＋ 2.1 ㎛	
	4000 ㎛	0.0014 ㎛/㎛ ＋ 5.5 ㎛	
	8000 ㎛	0.0032 ㎛/㎛ ＋ 25.0 ㎛	
渦電流式膜厚測定器 [F]	11 ㎛ to 836 ㎛		ISO2360 に基づく 作業手順書 膜厚計校正 (SRVOP001) フィルム：CH-STD-24075、CH-STD-24056-24876、CH-STD-24049-24687、CH-STD-2023-50316-23465 シリーズ ブロックゲージ
	11 ㎛	0.12 ㎛/㎛ ＋ 1.3 ㎛	
	72.8 ㎛	0.02 ㎛/㎛ ＋ 1.4 ㎛	
	836 ㎛	0.013 ㎛/㎛ ＋ 11 ㎛	
	1000 ㎛ to 3000 ㎛		
	1000 ㎛	0.0012 ㎛/㎛ ＋ 1.2 ㎛	
	1500 ㎛	0.0026 ㎛/㎛ ＋ 3.9 ㎛	
	3000 ㎛	0.0066 ㎛/㎛ ＋ 6.6 ㎛	
渦電流式位相式膜厚測定器 [F]	121.5 ㎛ 以下		ISO21968 に基づく 作業手順書 膜厚計校正 (SRVOP001) Zn/Fe Standard ESD20
	5.03 ㎛	0.068 ㎛/㎛ ＋ 0.34 ㎛	
	11.86 ㎛	0.049 ㎛/㎛ ＋ 0.59 ㎛	
	45.1 ㎛	0.030 ㎛/㎛ ＋ 1.4 ㎛	
	121.5 ㎛	0.014 ㎛/㎛ ＋ 1.7 ㎛	
電気抵抗式膜厚測定器 [F]	9.87 ㎛ 以下		ISO14571 に基づく 作業手順書 膜厚計校正 (SRVOP022) Cupper ISO Standard
	4.74 ㎛	0.12 ㎛/㎛ ＋ 0.57 ㎛	
	9.87 ㎛	0.12 ㎛/㎛ ＋ 1.1 ㎛	

認　定　証　付　属　書

株式会社フィッシャー･インストルメンツ
品質管理部
〒340-0012　埼玉県草加市神明 1-9-16
星野　廣記　Tel: 048-929-3455

本認定を、上記組織の実施する下記校正について授与する。

機械的校正

校正を受けた計量機器または計測器	範囲または必要に応じて基準装置サイズ	不確かさとして表現された校正測定能力(±)	使用された校正機器および基準、規格
蛍光Ｘ線膜厚測定器 [F]	1.68 ㎛ to 13.4 ㎛		ISO3497 に基づく 作業手順書 膜厚計校正 (SRVOP024) Zn/Fe Standard
	1.68 ㎛	0.11 ㎛/㎛ ＋ 0.18 ㎛	
	10.0 ㎛	0.11 ㎛/㎛ ＋ 1.1 ㎛	
	13.4 ㎛	0.11 ㎛/㎛ ＋ 1.4 ㎛	

1. この認定範囲を含む校正に対して記載された CMC(校正測定能力)は、ほぼ理想的な条件下でほぼ理想的な機器をおおよそ定められた方法で校正している試験所であれば、達成しうる最小測定不確かさを表している。それは、包含係数 k=2 を用いて 95%の信頼水準で表される。校正されている機器の能力や性能及び校正に関連する条件は、適度にある程度理想から逸脱しうるので、試験所が行っている特定の校正に関する実際の測定不確かさは、通常同じ校正に対する CMC より大きい。

2. 校正を認定する場合、校正機関の校正能力の範囲は校正を実施する際に用いる参照標準、標準物質等の最小値から最大値に起因される。従って、校正範囲の最低下限は校正機関が入手できる最低到達可能値でなければならない。
標準がない場合、手順や方法によって校正された０（ゼロ）の値を検証することによって、“0 点は校正ではない”とする定義を除けば、校正方法は手順に起因する。ただし、この場合、0 点の校正が全くできないとする定義は成立しないこともある。

3. 上付き文字“F”は、試験所がその恒久的施設において、示されたパラメータの校正を実施することを意味している。
（例：“Outside Micrometer[F]”は、試験所が固定された位置でこの校正を行うことを明確にしている。）